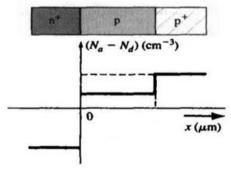
## 第二章 第3-4讲

- 4、理想的  $p^+n$  结为 T=300 K 时均匀掺杂的冶金结。掺杂浓度的关系为  $N_A=40N_D$ 。内建电势差为  $V_D=0.69$  V。反偏电压  $V_R=5$  V。设  $n_i=1.5\times10^{10}$  cm<sup>-3</sup>, $\epsilon_r=11.9$ 。计算:(1)  $N_A$ 、  $N_D$ ;(2)  $x_p$ 、 $x_n$ ;(3)  $|E_{max}|$ ;(4) C'(单位面积的势垒电容)
- 5、考虑反偏电压 8V 时的硅 p+n 结。当 P 区掺杂浓度变为原来的四倍时, (1) 求内建电势差的变化量; (2) 求势垒电容的变化比率。
- 6、反偏电压 VR=1 V,T=300 K 时,GaAs PN 结的总势垒电容为 1.2 pF。其中一侧的掺杂浓度为  $5\times10^{16}$  cm<sup>-3</sup>,内建电势差 VD=1.2 V。设  $ni=1.8\times10^6$  cm<sup>-3</sup>, $\epsilon r=13.1$ 。(1)计算另一侧的掺杂浓度;(2)结的横截面积;(3)当结电容变为 0.8 pF 时的反偏电压 VR。

## 第二章 第5-6讲

- 1、突变硅 p+n 结中 n 区的掺杂浓度为  $Nd=4\times10^{15}$  cm<sup>-3</sup>。当雪崩击穿发生时,耗尽区宽度是多少,假设 n 区足够长?
- 2、硅 pn 结的掺杂浓度为 Nd=Na= $5\times10^{18}$ cm-3。发生齐纳击穿时的临界电场为  $10^{6}$ V/cm。设 ni= $1.5\times10^{10}$ cm-3, $\epsilon$ r=11.9。求击穿电压的值(不忽略内建电势)。
- 3、二极管的掺杂曲线如图所示,即  $n^+pp^+$ 二极管。反偏时,耗尽区必须处于 p 区内,以防止过早的击穿。p 区的掺杂浓度为  $2\times10^{15}$  cm<sup>-3</sup>。 $\epsilon_r$ =11.9。计算使耗尽区处于 p 区内并且不发生击穿的反偏电压,假设 p 区长度为(a)75  $\mu$ m、(b)150  $\mu$ m。确定每种情况下,是耗尽区最大宽度先产生还是击穿先产生(忽略内建电势)? (可以当成  $n^+p$  结构考虑)



## 要求:

计算最终结果保留三位有效数字,本次作业 3.20(下周三)上课交。